

# KOHエッチング装置

## (型式:ETC-6001F/ETC-8001F)

SiCウエハやGaNウエハ等の熔融KOHによるエッチング処理を安全かつ精密に!!  
基板カゴにウエハをセットし、エッチング開始ボタンを押すだけ

### 【本装置のメリット】

- ・装置が密閉されているため、処理中のKOH蒸気/溶液との接触・暴露の可能性がほとんどありません。
- ・エッチング時間を設定すれば、自動でエッチングが行われます。
- ・基板カゴが回転しているため、手動で攪拌する必要がありません。

### 【適用】

- ・ウエハ表面欠陥評価
- ・ウエハ表面処理

### 【仕様表】

| 型式              | ETC-6001F                  | ETC-8001F        |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| ルツボサイズ          | Φ200×H169 (t2)             | Φ250×H190 (t2)   |
| 対応ウエハサイズ        | 6インチ                       | 8インチ             |
| 最高加熱温度(制御用熱電対値) | 700℃                       |                  |
| 温度安定性(制御用熱電対値)  | ±1℃                        |                  |
| 基板カゴ上下機構        | 自動                         |                  |
| 基板カゴ回転機構        | モータ駆動 (Max. 10rpm)         |                  |
| ルツボ蓋用シャッター機構    | 手動<br>(ルツボの蓋を機械的に開閉)       |                  |
| 液温測定用熱電対上下機構    | 手動<br>(機械位置から液温測定位置まで移動)   |                  |
| 電力              | 単相200V 20A                 | 単相200V 30A       |
| 排気ダクト径          | Φ100<br>※筐体内排気用排気設備をご準備下さい |                  |
| 装置サイズ(筐体)       | W750×D650×H1650            | W1000×D930×H2200 |
| 装置重量            | 190kg                      | 350kg            |
| オプション           | シグナルタワー                    |                  |

